

## 特徴

- ◆蒸着時のスプラッシュ発生を抑制(社内試験において85%削減)
- ◆屈折率2.0~1.45程度(条件により変動)
- ◆樹脂の密着層として優れた密着性を発現

## 用途

- ・光学分野  
(中間屈折率膜, 保護膜)
- ・フィルム分野(封止膜)
- ・樹脂分野など

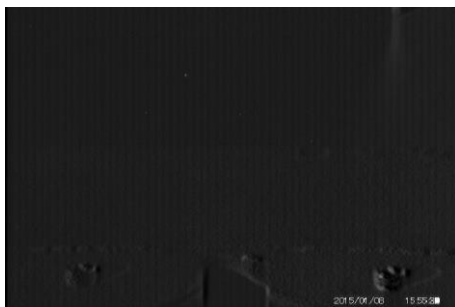
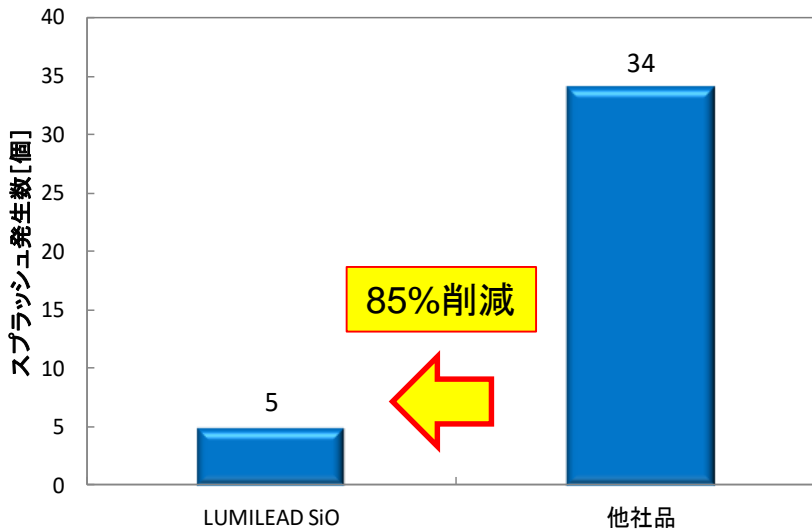
## 性能

### 成膜時のスプラッシュ発生数評価

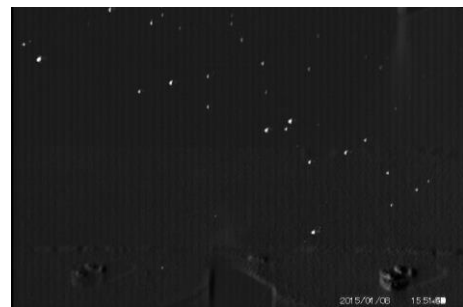
#### 測定条件

測定装置	微粒子可視化システム
蒸着レート	3 [Å/s]
測定時間	10 [sec] ※蒸着開始60secから70secまで

### スプラッシュ発生数



LUMILEAD SiO



他社品SiO

図. 発生したスプラッシュの積算合成画像

# 製品一覧

製品名	形状	サイズ
LUMILEAD SiO	不定形顆粒状	2-4 [mm]

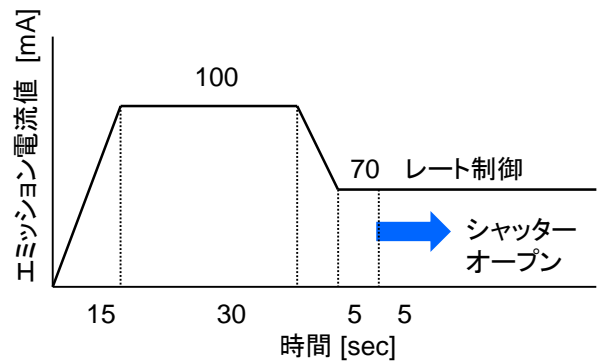


製品外観

## 成膜条件例

蒸着条件	
チャンバー径	Φ1300 [mm]
蒸発源	電子銃
酸素導入	$3.0 \times 10^{-2}$ [Pa]
イオンアシスト(IAD)	なし
蒸着距離	1100 [mm]
基板加熱	無加熱
蒸着レート	3 [Å/s]
膜厚	50 [nm]
蒸着開始真空度	$1.0 \times 10^{-3}$ [Pa]以下
被蒸着基板, サイズ	光学ガラスBK7 Φ30 × 3t [mm]

電子銃条件			
	AMP. [-]	エミッション 電流値 [mA]	時間 [分'秒]
プリメルト	6.5	100	0'30
蒸着	6.5	レート制御	-



- このパンフレットに掲載のデータは、全て弊社での測定値、または弊社が調査した文献値ですが、これを使用したことによる事故・損害には責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 製品を安全に正しくお使いいただくために、御使用の際には必ず製品安全データシートの記載内容をご覧下さい。
- 本パンフレットの内容は2019年4月時点のものです。仕様・製品の的外観は、改良等のために予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。
- 本パンフレットの内容は、無断転載、引用厳禁です。
- 製品について知りたい、相談に乗って欲しい、製品カタログが欲しいなど、製品についてご要望、ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

